

2019年度「配管システム等研究助成」実施要項

公益財団法人 イハラサイエンス中野記念財団

■助成趣旨

日本における機械装置の配管システム及びシステムを構成する製品分野の研究に対して助成することにより、研究を促進し国内の科学技術分野の振興に寄与する。

■助成内容

応募資格	機械装置の配管システム及びシステムを構成する製品分野の研究であって、公的な学術研究機関において実施されるもの。
助成期間	単年度を原則とする。
助成金額	助成金総額 500万円
応募方法	本財団所定の申込用紙に所定事項を記入の上、書留郵便にて本財団宛送付する。 受付締切日 2019年4月30日（必着）
選考結果通知	選考結果は2019年6月下旬に研究者及び推薦者に通知する。
支給方法・日	選考後、追って通知する。
報告書の提出	助成を受けた研究者または共同研究者は、2019年3月末日までに、研究の成果報告を提出すること。 尚、研究成果を発表する時は、「公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団」（英文は The Ihara Science Nakano Memorial Foundation）の助成による旨を書き添えること。 （様式は決定時に併せて送付致します。尚、報告書の提出がない場合は、次年度の推薦を受け付けない事があります。）

※選考結果および報告書はホームページにて掲載いたしますので、ご了承ください。

■書類送付先

〒108-0074東京都港区高輪3-11番3号
公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団
TEL 03-6721-6988 FAX 03-6721-6993